

# 主要設備

設備名	型式・メーカー	数量	適応サイズ		
			MAX	MIN	T
印刷機	SP28P-DH (ハナソニックファクトリーリユース)	1	360X460	80 X 50	2.0
印刷機	SPG (ハナソニックファクトリーリユース)	1	460X510	50 X 50	2.0
チップ部品搭載機(高速機)	CM202DS (ハナソニックファクトリーリユース)	1	360X460	80 X 50	2.0
チップ部品搭載機(汎用機)	CM301D (ハナソニックファクトリーリユース)	1	360X460	80 X 50	2.0
チップ部品搭載機	AM100 (ハナソニックファクトリーリユース)	1	460X510	50 X 50	2.0
チップ部品搭載機	AM100 (ハナソニックファクトリーリユース)	1	460X510	50 X 50	2.0
窒素発生装置	KN-4-50R (カネボウ)	1	-	-	-
	RN-22 (クラレケミカル)	1	-	-	-
ソルダーペーストミキサー	SP-500 (シンキー)	1	-	-	-
リフロー炉	XNK-745PC (古河電工)	2	450X510	50X80	±15
局部噴流共晶はんだ槽	MINI SOLEX	2	-	-	-
局部噴流Pbフリーはんだ槽	TOP-375(ガイド付き) (テクノデザイン)	1	-	-	-
	MINI SOLEX	1	-	-	-
自動局部噴流はんだ付け装置	TAKUROBO-L (弘輝TEC)	1	380X460	50 X 50	2.0
自動Pbフリーはんだ付け装置	TNW40-36EF (タムラ製作所)	1	400X360	50X120	1.6
スプレーフラクサー	SUPUROBO-L (弘輝TEC)	1	380X460	50 X 50	2.0
	TAF10-12F (タムラ製作所)	1	400X450	50X120	-
BGA,SMT リワーク装置	RD-500Ⅲ (デンオン機器)	1	500X600	50 X 50	
基板分割装置	MAESTO 4M	1	-	-	-
基板外観検査機	VT-RBT II-S (オムロン)	1	250X330	50 X 50	±20
基板卓上検査機	M22X-DL (マランツ)	1	460X350	50X50	±40
X線検査装置	WORK-LEADER WL-90 (ソフテックス)	1	400X400	-	-
絶縁抵抗計	IR4033-10/11 (日置電機)	1	-	-	-
耐圧試験機	3158 (日置電機)	1	-	-	-
デジタル顕微鏡	TW-TL5M (X4~X40) (ソニー)	1	-	-	-
実体顕微鏡	SZ61TR (オリンパス)	3	-	-	-
拡大鏡(X4~X8)		15	-	-	-
トルクテスター	HP-100 (ハイオス)	1	-	-	-
こて先温度計	HAKKO191 (白光)	2	-	-	-
リフローテスター	RCP-300(メモリRCM-6) (マルコム)	1	-	-	-
恒温恒湿室	TBR-32YPKL (エスペック)	1	-	-	-
	設定温度:-10~+80℃		-	-	-
	容 積:W 1,800 X L 1,970 X H 2,100mm		-	-	-
クリーンルーム	W 5,000XL 3,000XH 2,000 クラス10,000	1	-	-	-
加湿器	ROF-M4N (霧のいけうち)	1	-	-	-
ベーキング庫	25~220℃ WFO-450ND (EYELA)	1	-	-	-